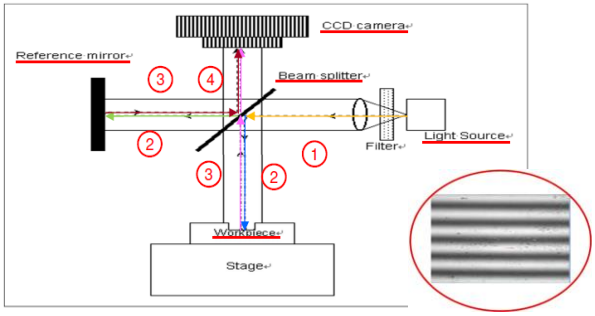
材　　料　　工　　程　　系

儀器名稱	：	白光干涉儀 (White light interferometer)
儀器負責人	：	李志偉 老師
分機	：	6313
地點	：	綜合大樓 104 光電性質檢測實驗室

儀器原理

白光干涉原理:

1. 以白光作為光源，經過分光鏡（Beam Splitter）
2. a. 一部份的光線為往試片表面而去
   b. 其餘的光線則射向參考面
3. 兩股光經反射後，形成白暗相間的干涉條紋
4. 干涉條紋的光強度會被 CCD 相機所接收和軟體分析



操作方法

1. 開啟電腦與機台電源。
2. 開啟掃描程式與機台連線。
3. 待機台自動校正完成後點擊 Load/Unload 按鈕，載台移出後放上試片，接著點擊中心 circle 使載台移回原處。
4. 找到量測處後調整 Z 軸對焦，接著調整干涉條紋至垂直或水平。
5. 調整完成後開始拍攝，取得 3D 圖選擇分析之功能，並存檔。
6. 量測完畢將 Z 軸之位置復歸至 15000μm、數位變焦調至 1x、模式調至 WLI、鏡頭轉回 10x。
7. 關閉程式(離線)、關閉電腦與機台電源並確實填寫儀器記錄簿。

儀器圖片:

注意事項

1. 機台自動校正時請勿放試片到載台上。
2. 使用後請確實於使用登記簿上簽名並詳填使用時間、指導老師、使用模組及儀器狀況等。
3. 如經發現未復歸，該使用者停權一個月。
4. 未經管理者同意嚴禁修改軟體設定，違規者取消權限。
5. 使用者必須遵守操作規範(如操作手冊)，非正常操作機台的一切行為一概禁止，如有不當使用之行為經發現將停權三個月，若有毀損儀器將負修理賠償責任永久取消該使用者資格。